

POLSKA  
RZECZPOSPOLITA  
LUDOWA



URZĄD  
PATENTOWY  
PRL

# OPIS PATENTOWY

# 108658

Patent dodatkowy  
do patentu nr \_\_\_\_\_

Zgłoszono: 18.05.77 (P. 198220)

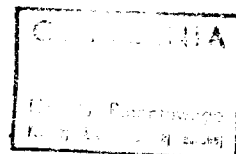
Pierwszeństwo: \_\_\_\_\_

Zgłoszenie ogłoszono: 27.02.78

Opis patentowy opublikowano: 29.11.1980

Int. Cl<sup>2</sup>.

B24B 53/04



Twórcy wynalazku: Kazimierz Lutek, Antoni Kossowski

Uprawniony z patentu : Politechnika Lubelska,  
Lublin (Polska)

## Przyrząd do obciągania tarcz ściernych

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do obciągania tarcz ściernych, zarówno do przywrócenia im zdolności skrawnych jak i dla ukształtowania ich pod kątem.

W znanym stanie techniki i dotychczasowej praktyce, do profilowania tarcz ściernych, pod odpowiednim kątem stosowane są sinuśnice i oprawki z diamentem oraz urządzenia do obciągania tarcz ściernych. Stosowanie sinuśnicy polega na ustawieniu jej pod żądanym kątem przy pomocy płytek wzorcowych, przy czym oprawkę z diamentem przesuwa się ręcznie po płaszczyźnie sinuśnicy. Niedogodnością tego jest konieczność ręcznego prowadzenia oprawki z diamentem po płaszczyźnie sinuśnicy a wadą nie zapewnienie prawidłowego zaprofilowania ściernicy, co ma niewątpliwy wpływ na dokładność obróbki. Konstrukcja urządzenia do obciągania tarcz ściernych jest podobna do sinuśnicy. Urządzenia te wprawdzie umożliwiają nastawienie kąta przy pomocy noniusza kąтового jak i za pomocą płytek wzorcowych, biorąc jednak pod uwagę brak w komplecie płytek o wymiarach od 1 mm (poza płytką 0,5 mm) niemożliwym jest zaprofilowanie ściernicy pod małym kątem. Wadą urządzenia do obciągania tarcz ściernych jest również to, że posiada mało sztywny układ do nadawania oprawce z diamentem ruchu prostoliniowo-zwrotnego w procesie obciągania.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności i wad występujących w dotychczasowych znanych rozwiązaniach oraz zaprojektowanie przenośnego przyrządu do profilowania tarcz ściernych pod kątem w zakresie od 0 do 90° a przy tym zapewnienie możliwości uzyskiwania wysokiej dokładności szlifowanych powierzchni jak i nastawianych kątów.

Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że przyrząd według wynalazku składa się z dwóch cylindrycznych prowadnic zabezpieczonych osłonami, suwaka połączonego dźwignią łożyskową łożyskiem oraz ma płytkę pomiarową z płaszczyznami pomiarowymi, przy czym jedna płaszczyzna pomiarowa na jednej trzeciej długości płytki pomiarowej jest obniżona w stosunku do płaszczyzny drugiej o 2 mm.

Konstrukcja przyrządu według wynalazku pozwala na profilowanie tarcz ściernych pod kątem w zakresie od 0 do 90° zapewniając przy tym uzyskanie wysokiej dokładności szlifowanej powierzchni jak i nastawianych kątów.

Przedstawione przykładowo rozwiązanie przyrządu według wynalazku pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie w widoku z boku, fig. 2 w widoku z góry, fig. 3 przekrój według linii E-E natomiast fig. 4 urządzenie w widoku od strony skali. Przyrząd składa się z podstawy kątovej 1, korpusu 2, we wspornikach którego są umocowane cylindryczne prowadnice 3 zabezpieczone osłonami 11 i płytki pomiarowej 12. Po prowadnicach 3 zabezpieczonych osłonami 11 przesuwają się suwak 4 i zamocowana w nim oprawka z diamentem 5. Korpus wraz z oprawką i diamentem 5 jest nastawny pod kątem z dokładnością  $10'$  za pomocą noniusza kątovej 6 z możliwością blokowania przy pomocy ramienia z wycięciem 7 i sworznia 8. Przesuwu oprawki z diamentem dokonuje się dźwignią 9 ułożyskowaną w łożysku 10. Płytki wzorcowe w czasie pomiarów układają się na płaszczyźnie pomiarowej C i D płytki 12, natomiast w celu rozszerzenia zakresu przyrządu pomiarowego dla pomiaru małych kątów, wykorzystuje się obniżoną płaszczyznę C. Do ustawienia przyrządu na obrabiarce służą płaszczyzny A lub B w zależności od kąta zaprofilowania ściernicy.

### Zastrzeżenie patentowe

Przyrząd do obciągania tarcz ściernych o dwóch płaszczyznach ustawczych i płaszczyźnie pomiarowej, z n a m i e n n y t y m , że składa się z dwóch cylindrycznych prowadnic (3) zabezpieczonych osłonami (11), suwaka (4) połączonego dźwignią (9) ułożyskowaną łożyskiem (10) oraz ma płytkę pomiarową (12) z płaszczyznami pomiarowymi (C) i (D), przy czym płaszczyzna pomiarowa (C) na jednej trzeciej długości płytki pomiarowej (12), jest obniżona w stosunku do płaszczyzny (D) o 2 mm.

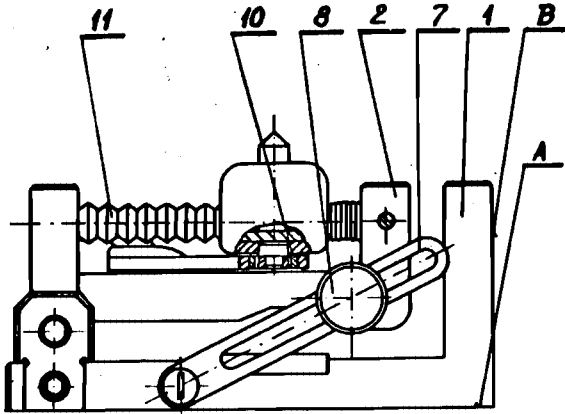


Fig. 1

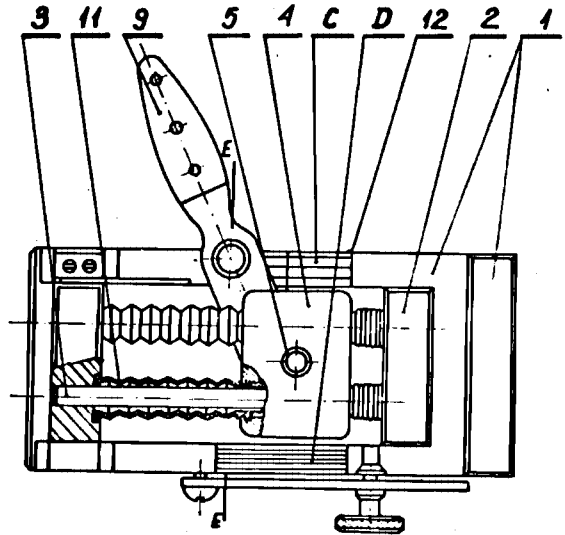


Fig. 2

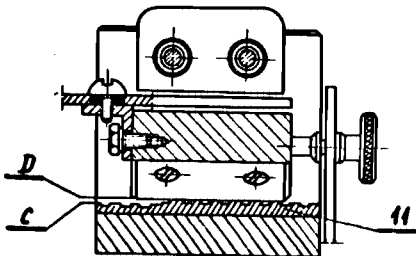


Fig. 3

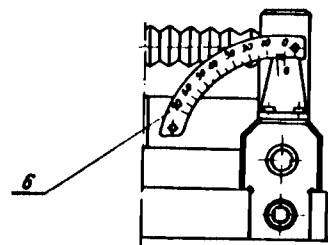


Fig. 4